

## 第1回研究設備センター先端研究設備部門会議議事録

日時：平成28年6月6日 16:30～17:15

場所：東8号館4F会議室

出席者：青山教授、内田准教授、守屋助教、牧助教、桑原准教授、加藤研究支援員、野崎教授

### 審議事項

1. 予約システム利用の徹底および利用状況の閲覧
  - (ア) マスタープランでの設備更新に影響を与えるので、学生には使用の際必ず、予約システムを利用し、使用記録を付けるよう徹底させる。
  - (イ) 光・バイオ室、機械・ロボット室での利用を徹底させるために、桑原委員にお願いして、研究設備センター名倉さんに説明会を開いてもらう。その日程調整は、両室長と名倉さんで行う。
  - (ウ) 次回のシステムの更新では、前年度登録した教員は、システムでの登録が残るようにしてほしい。
  - (エ) 予約システムにおける設備のトラブル報告のフォーマット導入を依頼した、
2. 今年度の運営について
  - (ア) 先端研究設備部門長を青山教授、副部門長を野崎教授が担当する。部門長が不在の際に研究設備センター運営委員会が開催された場合は、野崎副部門長が出席する。副部門長は、事務関係、予算申請の資料の作成等を行う。室長は、材料・デバイス室、機械・ロボット室、光・バイオ室、それぞれ野崎教授、青山教授、牧助教が担当する。その他部門委員として、守屋助教、桑原准教授、加藤研究支援員から構成される。事務補佐は、荒木さんが担当する。
  - (イ) 研究設備センター運営費における事務予算の減額により、大学より先端、基盤部門で事務を共同で行うよう要求されたが、先端、基盤の事務業務を一人の非常勤職員で行うことが今年度は、困難であることが確認され、昨年通り、荒木さんには、週3日半、先端部門の事務を担当してもらう。基盤部門より事務補佐の人件費の半額が先端に振り替えられ、残りの人件費は、材料・デバイス室により支払うこととした。しかし、来年度は、基盤部門では、これまでの非常勤職員の再雇用ができないので、荒木さんに基盤部門の事務も担当してほしいとの要求が桑原委員よりあった。今後、荒木さんの事務業務がどれだけ増えるのか具体的な検討をしていくこととした。
3. 今年度の予算（設備の維持・運営）及び会計
  - (ア) 運営費配分額

先端研究設備部門の運営費配分額が昨年度と比較して 35%減少した。減額された分を運営費の減額分を設備維持費により補てんするにも、設備維持費も前年度に比べて 12%減額した。この状況は平成 33 年度まで続く見通しであることが部門長より報告された。今後の先端研究設備部門の運営にあたっては、緊縮財政が必要となり、産学官連携により外部から予算を獲得する努力も必要である。

(イ) 先端研究設備部門運営費

運営費 WN01 の予算の管理は青山教授と野崎教授の 2 人にしている。設備の修理で予算が足りないときは、WN01 を充当する。

(ウ) 決算および予算

今年度の予算配分は、別紙 1-1 に基づいて審議され、提案を認めた。装置につく維持費については、別紙 1-1b のように財務より連絡があり、従来通りその装置を管理している室に配算する。ナノ微細加工と 3D マイクロ加工機について維持費については、昨年度のように購入費の割合で材料・デバイス室と機械・ロボット室に配分する。別紙 1-1 に示されるように、先端研究設備部門に配分された運営費が 35%昨年度の額より減額されたため、各室への配分および運営費をそれぞれ 35%減額した。しかし、実際の支出予定額は、予算額をうわまわるため、不足分は、可能な限り材料・デバイス室の予算で補てんする。光熱費については、運営費から支払う。節電が大学より要請された場合はできるだけ従う。使用についての課金については、当面使用者に課さないこととした。基盤研究設備部門と異なるのは、利用者が複数の設備を利用しているため課金を設備ごとに行うことが難しい点である。昨年度の各室、各装置の会計報告は、別紙 1-1c～e に示され、承認された。材料・デバイス室は基盤部門から昨年度借用している分については、今年度は返却困難なことを桑原委員に伝えた。

4. 装置の更新および設備マスタープランについて

来年度の概算に、今年度文科省に認められなかった先端研究設備部門から要求した先端ナノマシン材料システムが順位付け一番として含まれることが青山部門長より報告された。先端の FE-SEM は古いので部品がなくなってメンテナンスできなくなるかもしれない。使用頻度が高いのでぜひ、更新していただきたいが、最近では大きな設備の購入は認められておらず、設備購入は、学内予算措置でのみ行われている。年度末には、あたらなマスタープラン作成のための調査が全学で行われるが、先端として、引き続き先端ナノマシン材料システムを 1 番で要求していく予定だが、あたらめてメールまたは会議により要求設備の順位付けを行う。

5. 広報

(ア) 施設利用説明会（基盤研究設備部門と合同？）いつ、どのように行うか？

先端研究設備部門の材料・デバイス室では、常時登録施設利用者には、説明会を毎年

年度初めに行っている。今年度も、先端研究設備利用希望者を幅広く募るため学内にメールを出し、実施した。また、各装置の講習会で必要と思われる場合は、講習会の案内を全学に研究設備センター長の名前で研究推進課に依頼してメールで送る。機械・ロボット室と光・バイオ室は設備毎に対応するので説明会は開催しない。

(イ) ポスター（研究設備、研究）、ホームページの作成

東 8 号館の研究設備、研究紹介のパネルは昨年度更新したので、今年度はあらたには作成しない。先端研究設備部門の企業用、海外インターンシップ用（英語版含む）パンフレット、ホームページの作成は URA の特任教員と相談のうえ、作成する。装置の説明や写真はウェブ上で見られるが、pull-down メニューなどで見やすくする必要がある。URA に依頼して大学のホームページに組み入れてもらう必要があるため、URA の特任教員に積極的にかかわってもらうよう連絡する。まずは、昨年度、野崎委員が、森倉特任教員と相談したので、まずは森倉特任教員に連絡し、話が進まない場合は、部門長に URA に連絡してもらう。

(ウ) 研究成果報告書（基盤研究設備部門、低温部門と一緒）

昨年度同様、web 掲載のみとし、その原稿を 9 月末をめどに集めることを確認した。

(エ) 産学官連携 DAY での施設公開

昨年度同様、材料・デバイス室 2 名、機械・ロボット室 1 名、光・バイオ室 1 名の TA と研究支援員により公開し、クリーンルームの見学も要望に応じて実施する。今年度は、東 8 号館 1 階に相談コーナーを作り、見学に来られた方々に、施設利用の説明を行う。相談の対応は、各室長または室長代理が行う。

(オ) 利用者の拡大、課金

引き続き、内部、外部利用者を増加させる努力を行う。内部の利用者は確実に新任教員など含め拡大されているが、予算の健全化には、外部利用者の増加が必要で、企業の新規事業開発などに利用されるよう企業へのアピールとして、パンフレット、Web ページを充実させ、URA と連携をとる。企業との先端部門との共同研究により外部資金の獲得を目指す。また、海外インターンシップ受け入れセンターとなるように準備を行う。海外からの訪問者があった場合は、積極的にプレゼン、施設見学を担当する。今年度は、産学官連携 DAY に企業向けの相談室を設け、企業との共同研究を模索することにした。

## 6. グループ間の連携をどのようにしていくのか？研究基盤部門との差別化？

新規試みとして設置する相談室での先端部門の包括的な利用を企業の方に奨励することにより室間での連携が行われていくと期待される。